

MEDŽIAGŲ MOKSLO INSTITUTE

Padalinio pavadinimas	Pareigų pavadinimas	Etato dalis	Studijų kryptis	Reikalingos kompetencijos
Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija	Vyriausiasis mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Plonasluoksnių darinių ir paviršiaus inžinerijos bei susijusių analitinių procesų išmanymas, patirtis dirbant su lazerine spinduliuote, skenuojančia elektronine mikroskopija.
Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija	Vyresnysis mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Vakuuminių procesų ir vakuuminės analitinės technikos išmanymas, gebėjimai ir patirtis dirbant su elektroninės spektroskopijos priemonėmis.
Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija	Vyresnysis mokslo darbuotojas	0,5	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Plonasluoksnių darinių technologijų išmanymas, plonų sluoksnių mechaninių savybių vertinimas, patirtis dielektrinių medžiagų plonų plėvelių elektrinių savybių matavimuose.
Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija	Jaunesnysis mokslo darbuotojas	0,25	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Vakuuminių procesų ir vakuuminės analitinės technikos išmanymas, gebėjimai ir patirtis dirbant su elektroninės spektroskopijos priemonėmis bei elektriniais matavimais.
Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija	Vyriausiasis mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Vakuuminių procesų ir technologijų išmanymas, patirtis dirbant su dvimatėmis ir tūrinėmis mikro ir nanostruktūromis bei jų taikymais.
Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija	Vyresnysis mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Optinių spektroskopijų taikymas plonasluoksniams struktūroms bei nanokompozitams, patirtis Ramano spektroskopijoje ir infraraudonųjų spindulių spektroskopijoje.
Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija	Mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Vakuuminių ir plazminių technologijų išmanymas, patirtis dirbant su elektroninio garinimo, plazminio nusodinimo bei magnetroninėmis plonų dangų sistemomis.
Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija	Jaunesnysis mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Spektroskopinės elipsometrijos principų išmanymas, gebėjimas taikyti plonasluoksnių, daugiasluoksnių bei daugiafazinių struktūrų analizei.
Nano- ir mikrolitografijos mokslo laboratorija	Vyriausiasis mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Elektroninės nanolitografijos technologinių procesų išmanymas, patirtis dirbant su elektronine litografija bei taikymais mikro ir nanoprietaisų gamybai.
Nano- ir mikrolitografijos mokslo laboratorija	Vyresnysis mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Zondinių paviršiaus analizės metodų ir technikos išmanymas, patirtis dirbant su atominių jėgų mikroskopija ir vaizdų analizės programine įranga.
Nano- ir mikrolitografijos mokslo laboratorija	Vyresnysis mokslo darbuotojas	1,0	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Mikro ir nanolitografijų fizikinių principų ir technologijų žinojimas, patirtis nanoįspaudimo, bei kontaktinės UV litografijos srityje.
Nano- ir mikrolitografijos mokslo laboratorija	Jaunesnysis mokslo darbuotojas	0,5	Medžiagų inžinerija (08T); Fizika (02P)	Dvimačių nanostruktūrų formavimo gebėjimai, patirtis dirbant su kapiliarinio nusodinimo įranga, bei programine įranga fizikinių procesų skaitmeniniam modeliavimui.